(54) SPACE SOLAR CELL

(11) 1-27278 (A) (43) 1989 (19) JP

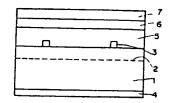
(21) Appl. No. 62-184125 (22) 22.7.1987

(71) SHARP CORP (72) YOSHIAKI TONOMURA

(51) Int. Cl⁴. H01L31/04,B64G1/44

PURPOSE: To obtain a silicon solar cell having desirable resistance to radiation, operable at low temperatures and hence capable of providing high output, by providing an anti-reflection film adapted mainly for the use in space environments.

CONSTITUTION: A silicon substrate 1 consisting of P-type silicon single crystals and having a specular face is provided with a photovoltaic junction 2 at a depth of $0.1 \sim 0.2 \mu m$ from the photodetecting face by diffusion of phosphorus or the like. Charge collecting electrodes 3, 4 are provided on the photodetecting and rear faces, respectively. In particular, the electrode 3 on the photodetecting face is shaped into "L" with a very narrow width so that it does not inhibit the incidence of light. The photodetecting face is further coated with an antireflection film 5 which is a single film of titanium dioxide or the like having refractive index of 2.35 to 2.45 and a thickness of 550 Å to 600 Å. Accordingly, the solar cell is allowed to have an maximum output after deterioration on radiation, for example after exposure on radiation for ten years. Further, since the solar cell has a high reflectance in a long wave range, it can operate at relatively low temperatures with its light absorbing ratio reduced.



6: silicone resin. 7: cover glass

(54) PHOTOCONDUCTING INFRARED DETECTING ELEMENT

(11) 1-27279 (A)

(43) 30.1.1989 (19) JP

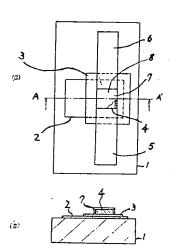
(21) Appl. No. 62-183926 (22) 22.7.1987

(71) NEC CORP (72) TOSHIO YAMAGATA

(51) Int. Cl⁴. H01L31/08,H01L21/316,H01L21/56

PURPOSE: To effectively inhibit recoupling of carriers on the top, bottom and side faces of an HgCdTe crystal stripe for improving sensitivity of an infrared detecting element, by providing a lower electrode layer on the bottom face of the HgCdTe crystal stripe with an insulating film interposed therebetween while providing an oxide film on the top and side faces of the stripe.

CONSTITUTION: An infrared detecting element comprises a lower electrode layer 2 formed at a predetermined position on a substrate 1, an insulating film 3 formed on the lower electrode layer, a stripe of HgCdTe crystals bonded onto the insulating film, first and second electrodes 5, 6 connected to the opposite ends of the stripe respectively, and an oxide film 7 formed on the top and side faces of the stripe 4. Accordingly, it is possible to obtain a photoconducting infrared detecting element capable of effectively inhibiting recoupling of carriers on the top, bottom and side faces of the element, while improving sensitivity thereof.



(b): cross section along A-A'

(54) MANUFACTURE OF SUPERCONDUCTOR

(11) 1-27280 (A) (43) 30.1.1989 (19) JP

(21) Appl. No. 62-184131 (22) 22.7.1987

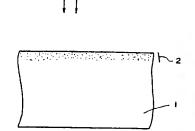
(71) SHARP CORP (72) KAZUSHI SUGAWARA

(51) Int. Cl4. H01L39/00

PURPOSE: To enable an n-type superconducting layer to be manufactured, by adding boron elements to a perovskite oxide composed of a IIIA element, a

IIA element, copper and oxygen.

CONSTITUTION: A cylindrical sample $(Y_1Ba_2Cu_3O_6+\delta)$ having a diameter of 1cm and a thickness of 5mm is prepared by a powder calcining process for example (Te is about 95K). Boron ions 3 accelerated at 100KeV are implanted in this cylindrical sample at a high dose of 10^{18}cm^{-2} . When boron ions are implanted in the superconductor 1 in this manner, it can be considered that the boron implanted layer 2 has a depth of about $2\sim 3\mu\text{m}$ from the surface. Since carriers introduced by the boron doping are electrons, a dose exceeding $1\times 10^{18}\text{cm}^{-2}$ corresponds to a carrier concentration per unit volume over $3\times 10^{21}\text{cm}^{-3}$, that is higher than the carrier concentration (p-type) of $3\times 10^{21}\text{cm}^{-3}$ of the undoped $Y_1Ba_2Cu_3O_6+\delta$. Thus, the conductivity type of the boron implanted region is inverted from P-type to n-type.



®日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-27278

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和64年(1989)1月30日

H 01 L 31/04 B 64 G 1/44 R-6851-5F Z-8817-3D

審査請求 有

発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 宇宙用太陽電池

②特 顧 昭62-184125

20出 顧 昭62(1987)7月22日

⑩発 明 者 殿 村

文 帝

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

⑪出 顋 人 シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

砂代 理 人 弁理士 杉山 毅至 外1名

明 楓 鬱

- 1. 発明の名称
 - 宇宙用太陽電池
- 2. 特許請求の範囲
 - 1. シリコン基板と、前配シリコン基板上に光起電力接合面を有する半導体表面と、前配半導体表面上に形成された反射防止線と、前配反射防止線上にシリコーン樹脂により接着された保護カバーガラスとを備え、前配反射防止線は、屈折率 2.3 5 乃至 2.4 5 かつ線厚 5 5 0 Å 乃至 6 0 0 Å である単一線から成ることを特徴とする宇宙用太陽電池。
 - 2. 前記反射防止機が、二酸化チタンから成ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の字 ・ 宙用太陽電池。
- 8. 発明の辞和な説明

〈蜜菜上の利用分野〉

本発明は太陽電池、とりわけ宇宙環境下で使用 されるシリコン太陽電池の反射防止膜に関するも のである。

く従来の技術>

太陽から放射される太陽光のエネルギー・スペ クトルは、大気圏外において第4図に示されるエ ホルギー強度を持っており、約500nm付近で 最大値を持つ。一方、ショコン太陽電池による発 電には、第4図に示される太陽光の全てが利用さ れるわけではない。適常シリコン太陽電池は、約 350 n m から約1100 n m までの光に対して 感度があり、その分光感度曲線は、例えば第5図 に示される様な形状を有する。 第5回は、最も広 く用いられている宇宙用シリコン太陽電池の分光 感皮曲線である。但し、これは表層に反射防止酸 が設けられていないものであり、その表層は第6 図に示される分光反射率を有している。太陽電池 の出力を増大させるため、その表層での入射光反 射を低減させる反射防止膜を設けることが知られ ている。

従来、反射防止線としては、一酸化ケイ累や五酸化タンタル等の屈折率が2.0付近の材料を用いた単層線、あるいは、米国特許明細等第4055422

号に示されるような、阻折率が2.35から2.4の 物質を用いた高屈折率層及び屈折率が1.6から 1.7の物質を用いた低屈折率層から成る2層膜が 知られている。これらの従来の反射防止膜は、太 隔電池の初期特性の改善を主目的としていた。

く発明が解決しようとする問題点>

第1図は一実施例を示す構造図である。図において、シリコン基板1は、鏡面処理が施されたP型シリコン単結晶であり、リン等の拡散により、受光面から0.1~0.2 pm の課さに光起面には、複合面2が形成されている。受光面及び裏面には、電荷収集用電極3・4が設けられ、特に受光面配は、電板は、光の進入を妨げないよう、極細くL型形状となっている。反射防止腺5は、屈折率約2.4、線厚約575人の物質である。具体的には二酸化テタンがこの物質に該当する。反射防止膜5の上には、シリコーン樹脂6(屈折率約1.4)により、保護カバーガラス7が貼り付けられる。

上記様選における反射防止膜の設計は、次のようになされている。第5回に示した反射防止膜の 無い太陽電池の分光感度から、第6回に示した表 層反射率の影響を取り除くと第2回の曲線Aとな る。とれは、実質的にシリコン基板内部に進入す る光に対する太陽電池の感度を表わす。放射級被 曝による格子欠陥等の損傷により、曲線Aの分光 本発明は、上記宇宙環境を主眼として設計された反射防止膜を設けることにより、耐放射線性に優れ、動作温度が低いととによる高出力が得られるシリコン太陽電池を提供することを目的としている。

く問題点を解決するための手段>

反射防止膜を、二酸化チタン等の屈折率 2.35 乃至 2.45 かつ胰厚 550 Å 乃至 600 Å である 単一級から機成する。

〈作用〉

上記により放射線劣化後、例えば10年間の放射線被爆後に太陽電池出力が最大となるようにできるとともに、長波長城での反射率が高いことにより、太陽光吸収率を低くして低温度勁作を可能にする。また反射防止膜をコーティングしたときの電流増加率(コーティングファクター)も従来の2層線と関等にできる。

く実施例>

以下図面に従って本発明の一実施例を詳細に説明する。

級皮は曲線Bのように長波長側から低下していく。 曲線Bは静止軌道上で10年間に被曝する放射線 を照射したものである。

第2図の曲線Bに示された特性を有する太陽電 他に、ある分光反射率Rを与える反射防止機を形 成したときの太陽電池の分光感度は、曲線Bを (1-R)で除したものになり、第4図の太陽光 分布との検により、放射線劣化後の太陽電池出力 が求められる。放射線劣化後の太陽電池出力を最 大にする単層反射防止機は、以上の計算から風折 率2.4、膜厚575Åと求められる。

次に、この反射防止機を備えた太陽電池の利点を、 従来の五酸化タンタルを用いた単腐反射防止 膜及び米国特許明細書第4.055.422号に示される2層反射防止膜との比較で述べる。第3図は、上記3種の反射防止膜を形成した場合の太陽電池の反射率を示す。尚、ここで保護カバーガラス7と真空との界面での反射及び保護カバーガラス7とシリコーン機脂6との界面での反射は零と仮定している。

曲級Pが本発明の反射防止膜、曲級Qが従来の 単層反射防止膜、曲線Rが従来の2層反射防止膜 によるものである。本発明による曲線Pが450 nmから650nm付近での反射率が最も低く、 第4図に示す太陽光の分布によくマッチングでは、 の出線Pが最も反射率が高いが、第2図に示すな明の の出線Pが最も反射率が高いが、第2図により保 の出線Pが最も反射率が高いが、第2図により保 でするため、反射率が高い方が太陽電池の出力保存 率は大きいことになる。また、長波長での反射率 が低くなる利点がある。

一方、下配裂は放射線劣化後の太陽電池に反射 防止線をコーティングしたときの電流増加率(コ ーティングファクター)を示す。

セルタイプ:BSR200

1 MeV ELETRON IE15 IRRADIATED カバーガラス付

ちなみに、従来の単層反射防止膜の放射線劣化 後のカバーガラス付太陽電池では、

屈折率 2.1、膜厚 7 6 0 Å

電流增加率 4 7.3 7 %

同従来の2層反射防止膜の放射線劣化後のカバー ガラス付太陽電池では、

低屈折率局 屈折率 1.65、胰厚 880 Å 高屈折率局 屈折率 2.3、 胰厚 580 Å

電磁増加率 5 1.3 2 6 5 で、本発明によれば、従来の2層膜と性質関等の

出力が得られる。

く発明の効果>

以上のように本発明の宇宙用太優児他は、宇宙

旋厚 屈折率

環境下で放射線劣化した太陽電池の出力を改善し、 かつ太陽光吸収率を低くすること等により高出力 が得られる。

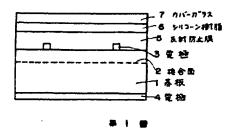
4. 図面の簡単な説明

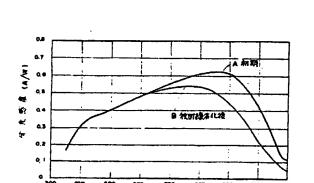
第1図は本発明の一実施例を示す構造図、第2 図は初期及び放射線劣化设の太陽電池の絶対分光 感度の一例を示す図、第3図は本発明の一実施例 における太陽電池の疫層反射率及び従来の太陽電 他の各袋層反射率の一例を示す図、第4図は大気 圏外における太陽光のエネルギー・スペクトル図、 第5図は反射防止膜を持たない太陽電池の分光感 度特性の一例を示す図、第6図は反射防止膜を持 たない太陽電池の裂層反射率の一例を示す図であ

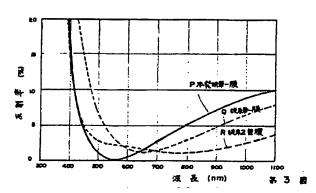
1 … シリコン基板、2 …光起電力接合面、3 、4 …電極、5 … 反射防止線、6 … シリコーン関脂、7 …保護カバーガラス。

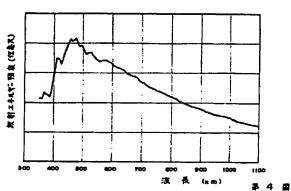
代理人 弁理士 杉 山 数 至(他1名)

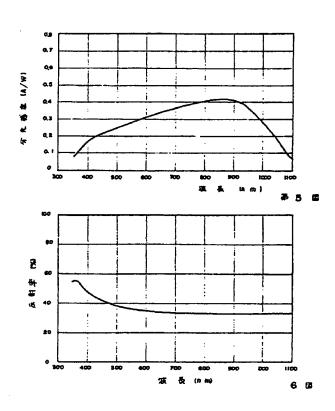
特開昭64-27278 (4)











班 長 (1707)

系 2 **卤**